



### 科研部门

#### 科研产出

- >> 抗辐射器件技术重点实验室
- >> 智能感知研发中心
- 论文
  - >> 微电子器件与集成技术重点实验室
  - >> 高频高压器件与集成研发中心
- 专利
  - >> 通信与信息工程研发中心
  - >> EDA中心
- 专著
  - >> 微电子仪器设备研发中心
  - >> 系统封装与集成研发中心
  - >> 集成电路先导工艺研发中心

### 管理部门

当前位置 >> 首页 >> 科研工作 >> 科研产出 >> 专利

- >> 健康电子研发中心
- >> 智能制造电子研发中心
- >> 光电技术研发中心
- >> 光刻技术总体部
- >> 新技术开发部
- >> 成果转化部

### 业务部门

- >> 综合办公室
- >> 产业化促进中心
- >> 党办
- >> 科技处
- >> 人事处

### 挂靠机构

- >> 中国科学院大学集成电路学院(国家示范性微
- >> 中国科学院大学集成电路学院(国家示范性微

### 支撑部门

- >> 基础保障部

### 科技条件平台

- >> 内设中心

### 学术社团

- >> 集成电路产业技术创新联盟

当前位置 >> 首页 >> 科研工作 >> 科研产出 >> 专利

>> 健康电子研发中心

>> 智能制造电子研发中心

>> 光电技术研发中心

>> 光刻技术总体部

>> 新技术开发部

>> 成果转化部

专利名称: 一种利用反射光谱测量单晶硅厚度及太阳能表面薄膜的方法及系统

专利类别: 发明专利

申请号: 201210281822.2

申请日期: 2012-08-09

专利号: 201210281822.2

第一发明人: 刘涛;王林梓;李国光;夏洋;Edgar Genio;马铁中

实施情况: 授权

专利证书号: 201210281822.2

其它备注: 八室一组

